

순번  
**267**

기술명

## 다층 저항식 다점 온도측정 웨이퍼 센서 및 그 제조방법

- 특허번호 : 10-2017-0044617
- 보유기관 : 한국표준과학연구원
- 패밀리정보 : WOWO2017-200267A1
- 패키징특허 : 없음

### 기술개요

- 복수의 전극 배선이 이루어지는 전극부를 포함하는 웨이퍼 센서의 전면적에 온도 균일도를 세밀하게 파악할 수 있는 기술
- 활용처 : 반도체 제조공정 중 웨이퍼 센서

### 기존 한계점

- 웨이퍼 센서의 소선과 리드선이 외부로 노출되어 있음
- 웨이퍼 센서 내에 다수의 측온 저항체를 설치하는 경우 소선과 리드선의 배열이 복잡하여 설치 개수에 제한이 발생
- 센서 전면적에 대한 온도를 균일하게 파악하기 어려움

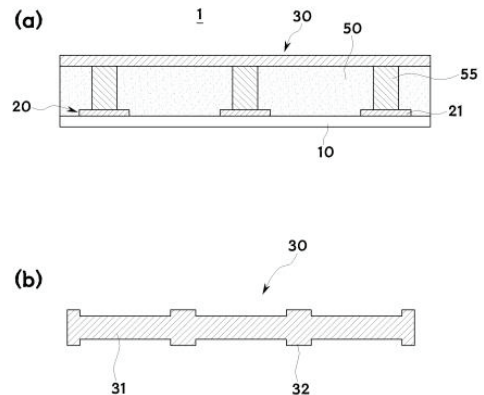
### 기술 차별점

- 전극부와 저항부가 서로 다른층에 형성
- 저항부의 단위저항과 연결배선이 전극부의 방해를 받지 않고 웨이퍼의 전면적에 설치 가능
- 웨이퍼 전면적에 대한 균일한 온도 파악 가능

### 세부내용

- 복수개의 전극 배선이 형성되는 전극부와 전극부와 다른 층을 갖는 저항부가 구비되며, 전극부를 통하여 상기 저항부에서의 전위차를 측정하여 상기 웨이퍼의 온도 균일도를 측정 가능
- 공정챔버 내부의 온도가 반영되도록 저항부가 표면에 노출되도록 설정되어 온조를 측정할 수 있음

### 대표 이미지



문의처

- 국가과학기술연구회 공동TLO마케팅사무국 엄예지 선임연구원
- T. 042-862-6986 E-mail. yjeum@wips.co.kr